

レーザー学会第 540 回研究会
「次世代レーザー加工」のご案内

日 時：2019 年 11 月 1 日（金）13:00～

場 所：北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場（〒060-0819 北海道北区北 19 条西 11 丁目）

交 通：地下鉄市営南北線「北 18 条駅」よりタクシー約 5 分。徒歩約 15 分。

（参照：<http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/index.html>）

内 容：次世代表面改質技術開発、次世代レーザー光源、加工プロセスなど

参加費：無料、

研究会報告代：会員（共催含）2,000 円，非会員 3,000 円，

学生会員：1,000 円，学生非会員：1,500 円（学生の聴講のみは無料）

報告単品購入 1 部 2,000 円（当日価格、税込）

共 催：レーザー学会「次世代産業用レーザー」技術専門委員会、溶接学会北海道支部

併 催：レーザープラットフォーム協議会セミナー

担当委員：塚本雅裕（大阪大学接合科学研究所）

TEL/FAX 06-6879-8675 E-mail: tukamoto@jwri.osaka-u.ac.jp

プログラム：

1) 「ファイバ結合型高輝度青色半導体レーザー BLUEIMPACT の紹介とその加工例」

諏訪 雅也（(株)島津製作所基盤技術研究所 光技術ユニット）

2) 「青色半導体レーザーの開発と加工への応用展開」

東野 律子（大阪大学接合科学研究所）

3) 「200 W 青色半導体レーザーを用いた純銅板のビードオンプレート溶接」

森本 健斗（大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻）

4) 「固形当て材および酸化物フラックスを用いた大出力レーザー溶接欠陥防止工法」

野村 涼（(株)ナ・デックス レーザ R&D センター）

5) 「フェムト秒レーザーのダブルパルス照射によるシリコン加工の初期過程」

甲藤正人 1、横谷篤至 2、加来昌典 2、塚本雅裕 3（1 宮崎大 CRCC，2 宮崎大工，3 大阪大 JWRI）

6) 「プラズマ閉じ込め層の音響インピーダンス制御によるレーザーピーニング効果向上に関する研究」

中野人志、Noor Shahira binti Masroon、秦 章浩、津山美穂（近畿大学理工学部電気電子工学科）